

JSCA表面化学分析国際標準化セミナー2016
—表面分析・マイクロビームアナリシスにおける国際標準化の動向—

主催: 表面化学分析技術国際標準化委員会

共催: (国研) 物質・材料研究機構 先端材料解析研究拠点

日時: 9月8日(木) 10:00~17:00

場所: 幕張メッセ国際会議場 103 会議室

参加費: 無料

事前登録: 不要

問合せ先: 国立研究開発法人物質・材料研究機構 大西 桂子

Tel: 029-856-2740 E-mail: jsca@jsca-jisc.org

新技術・製品の国際的普及のためにも、技術内容が国際的に理解できる形で共有されていることが重要であることから、国際標準化への取り組みは極めて重要です。ここでは、材料の開発・評価に欠かすことのできないナノ領域の分析法であるTEM, SEM, EPMA等を対象としたマイクロビーム分析およびXPS, AES, SIMS, GDS, SPM, X線分析等の表面分析法とそのバイオ材料応用の標準化のこれまでの成果と展望について報告します。

時間	タイトル	講演者(所属)
10:00~10:05	開会挨拶	藤田 大介 ((国研) 物質・材料研究機構)
10:05~10:20	国際標準化戦略について	藤代 尚武 (経済産業省)
10:20~10:40	ISO/TC202 マイクロビーム分析 ~ 国際規格開発の歴史と将来展望 ~	大堀 謙一 ((株) 堀場製作所)
10:40~10:50	マイクロビーム分析に関する用語の国際標準化 ~ EPMA, AEM, SEMの用語集 ~	大堀 謙一 ((株) 堀場製作所)
10:50~11:10	電子線マイクロビーム分析(EPMA)の国際標準化 ~微小部簡便元素分析法(EPMA分析)の国際規格~	北村 壽朗 ((株) 島津製作所)
11:10~11:30	分析電子顕微鏡(AEM)の国際標準化 ~ TEMの倍率校正法と電子線回折法を中心として ~	亀井 一人 (早稲田大学)
11:30~11:50	走査型電子顕微鏡(SEM)の国際標準化 ~ 長さの標準とSEMの倍率校正 ~	松谷 幸 (日本電子(株))
11:50~13:50	休憩	
13:50~14:10	ISO/TC201表面化学分析)国際標準化の現状と展望	野中 秀彦 ((国研)産業技術総合研究所)
14:10~14:30	X線反射率測定法(XRR)および全反射蛍光X線分光法(TXRF)の国際標準化 ~X線による表面分析法の原理と使い方~	辻 幸一 (大阪市立大学)
14:30~14:50	生体材料の表面分析に関する国際標準化 ~TOF-SIMSのバイオ応用の現状~	木村 芳滋 (神奈川県立保健福祉大学)
14:50~15:10	表面化学分析に関する用語、一般的手順、データ処理の国際標準化 ~表面化学分析に取り組む際の共通する手引きを学ぶ~	柳内 克昭 (TDK(株))
15:10~15:20	休憩	
15:20~15:40	電子分光法(XPS, AES)の国際標準化 ~ピーク分離結果の記録の仕方~	吉川 英樹 ((国研) 物質・材料研究機構)
15:40~16:00	二次イオン質量分析法(SIMS)の国際標準化 ~正しいデータを得るために~	高野 明雄 ((株)トヤマ)
16:00~16:20	グロー放電分析法(GDS)の国際標準化 ~極微量元素分析の挑戦~	我妻 和明 (東北大学金属材料研究所)
16:20~16:40	走査型プローブ顕微鏡(SPM)の国際標準化 ~ナノスケールでの構造・物性測定ガイドライン~	井藤 浩志 ((国研) 産業技術総合研究所)
16:40~16:45	閉会挨拶	大堀 謙一 ((株) 堀場製作所)